

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成25年6月7日現在

機関番号:26402 研究種目:若手研究(B) 研究期間:2011~2012 課題番号:23760020 研究課題名(和文)ナノ欠陥を導入した希土類系高温超伝導薄膜のキャリア密度制御による 高性能化 研究課題名(英文) Improvement of critical current properties for nano-defects-doped high-T_c superconducting films by controlling charier density 研究代表者 春田 正和(HARUTA MASAKAZU) 高知工科大学・環境理工学群・助教 研究者番号:90580605

研究成果の概要(和文):液体窒素温度かつ磁場下において、実用レベルの臨界電流密度を有す る希土類系高温超伝導(RE123)薄膜の作製を目指して、RE123 薄膜中にナノサイズの柱状欠陥 (ナノロッド)を導入した。ナノロッド導入 RE123 薄膜の臨界電流特性は成膜温度(T_s)に強く依存 しており、T_sに依存したナノロッド形態と臨界電流特性の関係を明らかにした。また、臨界電 流特性のT_s依存性が超伝導母相組成によって異なることも明らかにした。さらに、超伝導母相 に二種類の希土類元素を混合することにより、T_sに依存しない臨界電流特性を有する RE123 薄 膜の作製に成功した。

研究成果の概要(英文): To fabricate rare-earth (RE) based high- T_c superconducting (RE123) films with high critical current density (J_c) under magnetic fields at 77 K, nanorods as columnar defects were introduced into the RE123 films. Critical current properties depended on T_s , and the relationship between J_c properties and morphology of nanorods were clarified. The T_s dependences of J_c properties were different according to the composition of the superconducting matrix. Moreover, T_s -independent J_c properties were achieved by the mixture of two different types of RE as the RE123 matrix using nanorod-doped RE123 films.

交	付	泱	定	貊
\sim		ν		12/

(金額単位:円)

	(並領半位・口)		
	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	1, 900, 000	570, 000	2, 470, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物性・結晶工学

キーワード:酸化物高温超伝導体、希土類系高温超伝導体、超伝導薄膜、臨界電流密度、臨界 電流特性、パルスレーザ堆積、結晶欠陥、ナノロッド

1. 研究開始当初の背景

希 土 類 系 高 温 超 伝 導 体 (REBa₂Cu₃O_y, RE123)は 90K 級の超伝導転移温度(臨界温 度)を有しており、次世代の電力輸送ケーブ ルや磁場応用向け超伝導ケーブルの開発が 進められている。高温超伝導ケーブルは薄膜 型の線材として提供され、液体窒素温度(77K) での動作となる。高温超伝導線材の応用には 十分な電流輸送能力(臨界電流密度、J_c)が 達成されておらず、その向上が求められてい る。J_cの向上には、以下の2つが設計指針と

なる。

- (1) 超伝導体内に侵入した磁束線を捕捉 する欠陥(非超伝導相)の導入
- (2) 母相である超伝導体自身の特性(臨界 温度、臨界磁場)の向上

RE123 薄膜においては、ナノロサイズの柱 状欠陥(ナノロッド)の導入により J_cの向上に 成功している。RE123 薄膜へのナノロッドの 導入は磁場下での J_c向上に有効であるが、J_c は応用に十分な値に達していない。また一方 では、ナノロッドの導入により臨界温度が低下している。臨界温度の低下は磁束線の捕捉能力(ピン止め力)の低下に繋がり、J_cが低下してしまう。つまり、臨界温度の低下を防ぐことにより、更なるJ_cの向上が可能である。

2. 研究の目的

RE123線材の実用化のためナノサイズの欠陥を導入することにより電流輸送能力の向上が行われているが、臨界温度の低下を伴っている。臨界温度の低下により、充分なJ。の向上を果たすことが出来ないうえ、動作温度である液体窒素温度からの温度マージンが小さくなってしまう。本研究課題では結晶化学的な立場から臨界温度の低下を改善し、液体窒素温度動作で且つ磁場下において革新的に高い電流輸送能力を有する RE123 線材の実現を目指す。

- (1) 超伝導母相の臨界温度を低下させない ナノロッドの導入方法を確立し、 RE123 薄膜のJ。向上においてブレーク スルーを引き起こす。
 - 超伝導結晶の格子歪みが少ないナノ ロッド材料を選定する。
 - ② 最適なキャリアドープ状態が得られるように超伝導母相の組成を制御する。
 - ③ 最適な酸素アニール条件を決定する。
- (2) ナノロッドを導入した RE123 薄膜において、数値目標として 10T を超える不可逆磁場を実現する。

不可逆磁場よりも低い磁場下では損失な く電気輸送が可能であり、実用的な臨界磁場 を表している。この不可逆磁場の向上はJ。の 向上を意味している。高温超伝導線材の応用 である医療用 MRI や磁気浮上列車では 10T 以上の実用的臨界磁場を必要としており、臨 界温度を低下させないナノロッドの導入に よりこれを達成する。

研究の方法

Nd:YAG レーザを用いたパルスレーザ堆積 (PLD)法により RE123 薄膜を作製する。PLD 法による RE123 薄膜の作製はエキシマレー ザを用いたものが主流であるが、装置の初期 導入コストおよびランニングコストが高い といった欠点がある。一方、本研究で用いる YAG レーザは比較的に初期導入コストも低 く、ランニングコストも安いといった特徴が ある。

PLD 法による成膜には、ナノロッド材料を 添加したターゲットを用いる。成膜過程にお いて、自己組織化により RE123 薄膜中にナノ ロッドを形成させる。この、ナノロッドを導 入した RE123 において以下の点に着目する。

- (1) ナノロッド導入 RE123 薄膜作製条件の 最適化 ナノロッド導入 RE123 の J_c特性は成 膜条件に依存していることが分かって きており、本研究では特に成膜温度(T_s) に着目した。成膜温度を変化させて作製 した薄膜の、J_c特性とナノロッド形態の 関係を明らかにする。
- (2) ナノロッド導入 RE123 薄膜のアニール 処理
 ナノロッド導入 RE123 薄膜の臨界温

度低下には、超伝導/ナノロッド界面に おける格子歪が影響していると考える。 格子歪に起因して、酸素量が低下し、臨 界温度の低下を招いている可能性があ る。このため、酸素雰囲気中でアニール 処理を行うことにより、臨界温度の改善 を図る。

- (3) RE/Ca 置換によるキャリア密度制御 前述のように、ナノロッド界面では酸 素量が低下している可能性がある。酸素 量の低下は、超伝導キャリア密度の減少 を意味している。この超伝導キャリア密 度の減少に対して、RE サイトに Ca 置換 を行うことによりキャリアを注入し、臨 界温度の改善を図る。
- (4) 超伝導母相組成制御 これまであまり関心が寄せられてい なかった、ナノロッドを導入した超伝導 "母相"の組成に着目する。異なる超伝 導母相組成において、J。特性およびナノ ロッド形態を詳細に調査し、J。の最大化 を図る。
- (5) ナノロッド材料の選択 格子定数の異なるナノロッド材料を 選択し、母相中でどのような形態のナノ ロッドを形成するか調査する。また、ナ ノロッド形態と J。特性の関係を明らか にし、最適なナノロッド導入の指針を得 る。

4. 研究成果

安価なNd:YAG レーザを用いたPLD 法によ り Y123 薄膜を作製した。成膜条件の最適化 により、エキシマレーザ PLD 法により作製し た Y123 薄膜と同等の高品質な特性の薄膜が 得られた(Haruta *et al.*, Physics Procedia, 2012)。 BaNb₂O₆(BNO)を添加したY123ターゲットを 用いて PLD 成膜を行うことにより、BNO ナ ノロッドを形成させた。これにより、磁場中 J_c が向上した。

 二軸配向した薄膜が得られる T_s範囲 (850~890℃)において BNO ナノロッド 導入 Y123 薄膜を作製した。図1にJ_cの 磁場依存性を示すように、 J_c 特性は T_s に依存しており、 T_s が高いほど高い磁場中 J_c が得られた。なお、900℃以上では膜の再蒸発が起きていた。このため、高い磁場中 J_c を有するナノロッド導入 RE123線材の製造においては、正確な製造温度制御が重要となる。

また、エキシマレーザ PLD 法にて作 製したナノロッド導入 Y123 薄膜におい ても、YAG レーザ PLD 法で作製した Y123 薄膜と同様な J_c の T_s 依存性を示し た。このため、 J_c の T_s 依存性はレーザ光 源に関係なく、PLD 法にて作製したナノ ロッド導入 RE123 薄膜特有の現象であ ることを明らかにした。(Haruta *et al.*, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 2012)



Haruta et al., Physics Procedia, 2012

図 1. BNO ナノロッドを導入した Y123 薄膜における J_cの磁場依存性

(2) BNOナノロッドを導入によりY123 薄 膜の磁場中J。は向上したものの、臨界温 度が低下していた。この臨界温度低下に 対して、酸素雰囲気中にてアニール処理 を施すことにより臨界温度の改善を図 った。350~450℃の間で、最適なアニー



春田ら,2011年度春季低温工学・超伝導学会

図 2. BNO ナノロッド導入 Y123 薄膜の アニール前後における J_cの磁場角度依存 性 ル条件(アニール時間も検討)を探索し たが、顕著な臨界温度の改善は得られな かった。しかしながら、図2に示すよう に J。に大きな変化が見られた。しかも、 磁場の印加方向によってアニール前後 での J。の変化に大きな違いが見られた。 磁場を c 軸に平行に印加した場合の J。 は、アニールにより低下していた。一方、 磁場を ab 面に平行に印加した場合の J。 は、アニールにより大きく向上していた (春田ら、2011年度春季低温工学・超電 導学会)。これは、アニールによる J. の 変化には異方性があることを示した重 要な結果である。また、アニール条件の 最適化により、臨界温度向上と更なる J。 向上が見込まれる。

- Y123 薄膜へのナノロッド導入による (3)臨界温度低下に対して、超伝導キャリア 密度制御の観点から、Y/Ca 置換を行っ た。Y サイトの 5%を Ca で置換した (Y,Ca)123 薄膜に BNO ナノロッドを導入 した。その結果、ナノロッド導入 Y123 薄膜と比較して T_sの向上には至らなか った。すでに報告されているようにナノ ロッドを導入していないピュアな Y123 薄膜では、Ca ドープによって臨界温度 が低下している。このため、ナノロッド 導入 Y123 薄膜において臨界温度の改善 を図るためには、Ca ドープ量の最適化 を行うとともに、酸素アニール工程も加 えるなどの工夫が必要であると考えら れる。
- (4) 研究計画当初の予定では、酸素アニー ルや RE/Ca 置換によるキャリア密度制 御により臨界温度を改善することによ り、J。を向上させることに主眼を置いて いた。しかしながら研究を進めていく中 で、成膜温度によってナノロッド形態が 変化しJ。特性が変化すること、母相組成 によってナノロッド形態の T。依存性が



Haruta et al., Appl. Phys. Exp., 2012

図 3. BNO ナノロッド導入(Y_{1-x}Er_x)123 薄 膜における磁束線補足能力の成膜温度依 存性 異なるなど新たな発見があったため、以 下の内容に研究の主軸を移していった。

前述のように BNO ナノロッドを導入 した Y123 薄膜では、T_sが高いほど J_c特 性が向上していた。図 3 に磁束線の捕捉 能力(∝J_c)の T_s 依存性を示すように、T_s が高いほど磁束線補足能力(J_c)が高いこ とを示している。一方 BNO ナノロッド を導入した Er123 薄膜では、成膜温度の 低下に伴い J_c特性が向上しており、Y 系 とは全く逆の振舞いを示した。このよう に、ナノロッドを導入した RE123 薄膜に おいては、母相組成により J_c特性の成膜 温度依存性が異なることを明らかにし た。なお、77K における不可逆磁場はナ ノロッド導入 Y123 薄膜の場合約 9T であ ったのに対し、Er123 の場合約 13T と高



Haruta et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 2013

図 4. BNO 添加 Y123 薄膜の透過電子顕 微鏡写真:(a)成膜温度=850℃、(b)890℃



Haruta *et al.*, IEEE Trans. Appl. Supercond. (2013)

図 5. BNO 添加 Y123 薄膜におけるナノ ロッドの長さ(*L*^{rod}/*L*^{film})と傾き(*φ*)の成膜 温度依存性 い値を示した。

BNO ナノロッド導入 Y123 および Er123 薄膜の透過電子顕微鏡観察により ナノロッド形態の成膜温度に対する変 化を明らかにした。図 4 に BNO 添加 Y123薄膜の透過電子顕微鏡写真を示す。 Y系において、低温成膜(図 4a)ではナノ ロッドが短く傾いて成長しているのに 対し、高温成膜(図 4b)ではナノロッドは 長く垂直に成長していた。図5にナノロ ッドの長さ(膜厚で規格化したナノロッ ドの長さ: $L^{\text{rod}}/L^{\text{film}}$)および傾き(ϕ)の T_s 存性を示すように、ナノロッド形態が Ts に強く依存していることが分かった。一 方、Er 系では T_cに対してナノロッドの 形態はあまり変化しないが、T.の増加に 伴いナノロッドの密度が増加した。この ような T_sに対するナノロッドの形態お よび密度の変化に起因して、J。特性が成 握温度に依存することが明らかとなっ た。このため、RE123 線材の製造におい てナノロッド導入により高い J_c 特性を 得るためには、母相組成とナノロッド材 料の組み合わせを考慮したうえで、製造 温度を精密に制御する必要があること が明らかとなった。

RE123 薄膜のJ。特性はナノロッドの導 入により改善することに成功したが、T_s によってその特性は大きく変化してい た。成膜温度による特性変化は、RE123 線材の製造において大きな問題である。 この問題に対して、Y 系と Er 系では J_c 特性の T_s 依存性が異なることを利用し て、Y と Er の二種類の希土類元素を混 合した超伝導母相にナノロッドを導入 した。図3に示すように、YとErの組 成比を調整することにより T。に依存し ない J。特性を有する RE123 薄膜の作製 に成功した。本研究結果により、多少の 製造温度の変動に対しても空間的に均 ーで高い J。特性を有する長尺の RE123 線材の製造が可能になる。

(5)ナノロッド材料として BNO 以外に、 BaZrO₃(BZO)、BaSnO₃(BSO)を添加した Y123 薄膜を作製した。ナノロッドの種 類により、ナノロッド形態およびナノロ ッド密度の T。依存性が異なっていた。ナ ノロッド導入 RE123 薄膜の微細組織と 臨界温度の関係を調べた結果、ナノロッ ド密度と臨界温度に相関があることが 分かった。さらに、ナノロッド―ナノロ ッド間隔が 5~8nm 程度になったとき急 激に臨界温度が低下することが分かっ てきた。つまり、超伝導/ナノロッド界 面から 5~8nm の領域では結晶格子がひ ずんでおり、この歪に起因して臨界温度 が低下していると考えられる。このため

J. を最大化させるためには、界面での格子 歪が小さくなるような超伝導母相と ナノロッド材料の選択が重要である。

これら研究成果により、以下に示す RE123 線材の実用化に向けた重要な知見が得られ た。優れた磁場中 J。特性を有するナノロッド 導入 RE123線材を製造する際には、ナノロッ ド材料と母相材料の組合せを考慮したうえ で成膜温度を精密に制御する必要がある。臨 界温度の低下を防ぐためにはナノロッド超 伝導/ナノロッド界面での格子歪が小さい 材料を選択する。二種類の希土類を混合した 母相にナノロッドを導入することにより T_s に依存しない J。特性が得られる。

5. 主な発表論文等 (研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計7件)

- M. Haruta, K. Saura, N. Fujita, Y.Ogura, A. Ichinose, T. Maeda, S. Horii, "Relationship between vortex pinning properties and microstructure in Ba-Nb-O-doped YBa₂Cu₃O_y and ErBa₂Cu₃O_y films", Physica C, *in press*, 2013, 査読有, 10.1016/j.physc.2013.04.044
- [2] N. Fujita, <u>M. Haruta</u>, A. Ichinose, T. Maeda, S. Horii, "Dependence of critical current properties on growth temperature and doping level of nanorods in PLD-YBa₂Cu₃O_y films", Physica C, *in press*, 2013, 査読有, 10.1016/j.physc.2013.04.052
- [3] <u>M. Haruta</u>, A. Ichinose, N. Fujita, K. Saura, T. Maeda, S. Horii, "Critical current properties in REBa₂Cu₃O_y films with nanorods depending on growth conditions", IEEE Trans. Appl. Supercond. ,Vol.23, 8000904(4p), 2013, 査読有, 10.1109/TASC.2012.2233541
- [4] <u>M. Haruta</u>, A. Ichinose, N. Fujita, Y. Ogura, T. Nakata, T. Maeda, S. Horii, "Growth-Temperature-Independent Nanostructure in (Y_{1-x}Er_x)Ba₂Cu₃O_y Films with Ba-Nb-O Nanorods", Appl. Phys. Exp., Vol.5, 073102(3p), 2012, 査読有, 10.1143/APEX.5.073102
- [5] <u>M. Haruta</u>, N. Fujita, Y. Ogura, T. Nakata, T. Maeda, A. Ichinose, P. Mele, and K. Matsumoto, "Relationship between critical current density and nanorod morphology in REBa₂Cu₃O_y thin films", Mat. Res. Soc. Symp. Proc., Vol.1434, 2012, 査読有, 10.1557/opl.2012.1588
- [6] <u>M. Haruta</u>, N. Fujita, T. Maeda, and S. Horii,

"Influence of deposition temperature on critical current properties for Nd:YAG-PLD-YBa₂Cu₃O_y thin films with nano-rods", Physics Procedia, Vol.36, pp.1576-1581, 2012, 査読有,

10.1016/j.phpro.2012.06.213

[7] S. Horii, N. Fujita, Y. Ogura, T. Maeda, <u>M.</u> <u>Haruta</u>, "Fabrication and critical current properties in Nd:YAG-PLD REBa₂Cu₃O_y (RE= Y and Er) thin films", Physics Procedia, Vol.27, pp.220-223, 2012, 査読 有, 10.1016/j.phpro.2012.03.450

- - -

〔学会発表〕(計 24 件)

- [1] <u>春田正和</u>, 一瀬中, 藤田夏斗, 佐浦啓介, 小椋裕太, 前田敏彦, 堀井滋, "ナノロ ッド導入 REBa₂Cu₃O, 薄膜における成膜 条件に依存した局所的臨界電流密度分 布", 第 60 回応用物理学会春季学術講演 会, 2012 年 3 月 29 日, 神奈川工科大学
- [2] <u>春田正和</u>, 佐浦啓介, 藤田夏斗, 小椋裕 太, 一瀬中, 前田敏彦, 堀井滋, "異な った組成のナノロッドを含む YBa₂Cu₃O_y 薄膜の臨界電流特性", 第 60 回応用物理 学会春季学術講演会, 27p-G2-6, 2012 年 3月 27 日, 神奈川工科大学
- [3] <u>M. Haruta</u>, K. Saura, N. Fujita, Y. Ogura, A. Ichinose, T. Maeda, S. Horii, "Relationship between vortex pinning properties and microstructure in Ba-Nb-O doped REBa₂Cu₃O_y films", 25th International Symposium on Superconductivity, December 4, 2012, Tokyo
- [4] N. Fujita, <u>M. Haruta</u>, A. Ichinose, T. Maeda, S. Horii, "Dependence of critical current properties on growth temperature and doping level of nanorods in PLD-YBa₂Cu₃O_y films", 25th International Symposium on Superconductivity, December 4, 2012, Tokyo
- [5] S. Horii, N. Fujita. K. Saura, Y. Ogura, T. Maeda, <u>M. Haruta</u>, "Microstructures of (Y,Er)Ba₂Cu₃O_y thin films with Ba-Nb-O nanorods", 25th International Symposium on Superconductivity, December 4, 2012, Tokyo
- [6] 藤田夏斗, <u>春田正和</u>, 一瀬中, 堀井滋, "ナノ結晶欠陥導入による希土類系超 伝導薄膜の高性能化", 高知工科大学ナ ノテクノロジーシンポジウム 2012, 2012 年 11 月 17 日, 高知工科大学
- [7] 春田正和, 佐浦啓介, 藤田夏斗, 小椋裕 太, 一瀬中, 前田敏彦, 堀井滋, "Ba-Nb-O 添加 RE123 薄膜における成膜温度に依 存したナノロッド形態の変化と局所的 臨界電流密度分布の関係", 第 86 回低温

工学・超電導学会研究発表会, 2012 年 11月9日, 岩手

- [8] <u>M. Haruta</u>, A. Ichinose, N. Fujita, K. Saura, T. Maeda, S. Horii, "Critical current properties in REBa₂Cu₃O_y films with nanorods depending on growth conditions", Applied Superconductivity Conference 2012, October 11, 2012, Portland, USA
- [9] (invited) M. Haruta, A. Ichinose, N. Fujita, Y. Ogura, T. Nakata, T. Maeda, S. Horii, "Nanostructure critical and current properties for different RE composition in $REBa_2Cu_3O_{\nu}$ films with nanorods", IUMRS-ICEM, September 25, 2012, Yokohama
- [10] 小椋裕太, <u>春田正和</u>, 一瀬中, 堀井滋, 前田敏彦, "Nd:YAG-PLD 法で作製した ナノロッド導入 ErBa₂Cu₃O_y 薄膜の臨 界電流特性", 第 73 回応用物理学会学術 講演会, 2012 年 9 月 13 日, 松山
- [11] 堀井滋, 春田正和, "酸化物系高温超伝 導体の材料化研究:配向組織制御とナノ 構造制御",第73回応用物理学会学術講 演会(「応用物理学会・中国四国支部に おける酸化物材料研究の紹介」の一環と して常時展示),2012年9月13日,松山
- [12] 藤田夏斗, <u>春田正和</u>, 一瀬中, 前田敏彦, 堀井滋, "Nd:YAG-PLD 法によるナノロ ッド導入 YBa₂Cu₃O_y 薄膜の作製と臨界 電流特性の成膜温度・ナノロッド添加量 依存性", 第 73 回応用物理学会学術講演 会, 2012 年 9 月 12 日, 松山
- [13] (招待講演)<u>春田正和</u>,一瀬中,堀井滋: "製造温度に依存しない臨界電流特性 を有するナノロッド導入 REBCO 薄膜の 作製と微細組織評価",第73回応用物理 学会学術講演会,2012年9月11日,松 山
- [14] T. Maeda, <u>M. Haruta</u>, Y. Ogura, N. Fujita, T. Nakata, S. Horii, "Irreversibility behavior of REBa₂Cu₃O_y (RE: Y or Er) films prepared by Nd:YAG pulsed-laser- deposition method", International Cryogenic Engineering Conference 24 / International Cryogenic Materials Conference, May 12, 2012, Fukuoka
- [15] <u>M. Haruta</u>, N. Fujita, Y. Ogura, T. Nakata, T. Maeda, A. Ichinose, P. Mele, K. Matsumoto, "Relationship between critical current density and nanorod morphology in REBa₂Cu₃O_y thin films", 2012 MRS Spring Meeting, April 10, 2012, San Francisco, USA
- [16] 春田正和,藤田夏斗,小椋裕太,中田貴 大,前田敏彦,堀井滋,"製造温度に依 存しない臨界電流特性を有するナノロ ッド導入 REBCO 薄膜の作製",第 59回

応用物理学関係連合講演会,2012 年 3 月 17 日,早稲田大学

- [17] (招待講演) 堀井滋,Y系超電導薄膜に おける磁東ピンニング機構~ナノロッ ド導入効果~,低温工学・超電導学会第 3回材料研究会,平成23年12月26日, 九州工業大学
- [18] 春田正和,藤田夏斗,小椋裕太,中田貴 大,前田敏彦,堀井滋,"薄膜型高温超 伝導線材創製に向けたナノ欠陥制御技 術の構築",高知工科大学ナノテクノロ ジー研究所シンポジウム 2011,2011 年 12月3日,高知工科大学
- [19] <u>春田正和</u>,藤田夏斗,小椋裕太,中田貴 大,前田敏彦,堀井滋:"REBa₂Cu₃O_y薄 膜組成によるナノロッドの形態制御", 第 85 回 2011 年秋季低温工学・超電導学 会,2011 年 11 月 10 日,金沢
- [20] S. Horii, N. Fujita, Y. Ogura, T. Maeda, <u>M.</u> <u>Haruta</u>, "Fabrication and critical current properties in Nd:YAG-PLD REBa₂Cu₃O_y (RE= Y and Er) thin films", 24th International Symposium on Superconductivity, October 25, 2011, Tokyo
- [21] <u>M. Haruta</u>, N. Fujita, Y. Ogura, T. Maeda, S. Horii, "Deposition temperature dependent vortex-Bose-glass state in Nd:YAG-PLD REBa₂Cu₃O_y thin films with nano-rods", 24th International Symposium on Superconductivity, October 25, 2011, Tokyo
- [22] <u>M. Haruta</u>, N. Fujita, T. Maeda, S. Horii, "Influence of deposition temperature on critical current properties for Nd:YAG-PLD-YBa₂Cu₃O_y thin films with nano-rods", Superconductivity Centennial Conference (European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS), September 20, 2011, Netherland
- [23] <u>春田正和</u>,藤田夏斗,前田敏彦,堀井滋, "Nd:YAG-PLD 法を用いたナノロッド 導入 YBa₂Cu₃O_y 薄膜における磁束ピン ニング特性の成膜温度依存性",第72回 応用物理学会学術講演会,2011年9月1 日,山形大学
- [24] <u>春田正和</u>,藤田夏斗,小椋裕太,北野弘 典,前田敏彦,堀井滋,"Nd:YAG-PLD 法による REBa₂Cu₃O₂薄膜の作製と臨界 電流特性",第72回応用物理学会学術講 演会,2011年9月11日,山形大学

6. 研究組織

(1)研究代表者
春田 正和(HARUTA MASAKAZU)
高知工科大学・環境理工学群
研究者番号:90580605